

平成27年度 予算配分

運営費配分	H27配分額	H26配分額	
材料・デバイス室(WN11)	9,442,300	10,045,000	円
光・バイオ室(WN12)	460,600	490,000	
機械・ロボット室(WN13)	37,412	39,800	
運営(WN01)	3,785,072	4,072,000	
	計	13,725,384円	
		(-6%)	
設備維持費配分(別紙参照)			
材料・デバイス室(WN11)	8,922,000	8,104,000	
機械・ロボット室(WN13)	551,000	480,000	
	計	9,473,000	8,584,000

平成27年度 支出案

支出	運営費		
	人件費(1人)	1,300,000	
	年報・パンフレット	120,000	
	コピー機、プリンター関連	70,000	
	ソフトウェア等パソコン関連	70,000	
	事務用品	76,072	
	謝金(産学官連携DAY、スーパーユーザ)	200,000	
	SVBL棟保守・点検・修理、設備維持支援	549,000	
	空調機保守点検	300,000	
	電気代	1,100,000	
	計	3,785,072	

別紙1-1b

部局等名: 研究設備センター(先端研究設備部門)

【平成27年度】

No.	事項名(設備名)	基準積算額(千円)	配分希望額(千円)	設備管理者氏名	予算詳細
1	電子ビーム露光	944	944	野崎 眞次	WN11
2	多機能オプトエレクトロニクス デバイス作製・研究設 備(SVBL)	3,414	3,414	野崎 眞次	WN11
3	有機金属気相成長 (MOCVD)装置	1,916	1,916	野崎 眞次	WN11
4	ウェットステーション	556	556	野崎 眞次	WN11
5	ナノ微細加工と3Dマ イクロ加工設備	2,643	2,092	野崎 眞次	WN11
			551	青山 尚之	WN13
	合計	9,473	9,473		

※1. 基準積算額の合計と配分希望額の合計を一致させてください。

※2. 「設備使用実績」欄は、これまでの設備の使用状況や維持運営費の使用用途、及び今年度の予定など配分希望額の根拠